محاسبهٔ خواص مکانیکی و ترمودینامیکی ساختار **3**C کربید سیلیکون با

استفاده از دینامیک مولکولی و نظریهٔ تابعی چگالی

ایمان پیوسته، احمد رضایی، قاسم الهیاری زاده*، عبدالحمید مینوچهر، مهدی آقایی دانشکدهٔ مهندسی هستهای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دریافت: 1397/01/14 ویرایش نهائی: 1397/04/05 پذیرش: 1397/07/30

چکیدہ

کربید سیلیکون به خاطر خواص فوق العاده مکانیکی، فیزیکی، ترمودینامیکی و شیمیایی، یک سرامیک بسیار جذاب برای اکثر صنایع است. در این پژوهش خواص مکانیکی و ترمودینامیکی ساختار 3C کربید سیلیکون با استفاده از شبیه سازی های دینامیک مولکولی و نظریهٔ تابعی چگالی مبتنی بر تقریب شیب تعمیم یافته در دما و فشارهای بالا محاسبه و جهت صحت با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است. محاسبات دینامیک مولکولی با استفاده از پتانسیل های بین اتمی ترسوف و واشیشتا صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی دلالت بر این دارد که هر دو پتانسیل قابلیت بالایی در بهینه سازی ساختارهای مورد نظر دارند. خواص مکانیکی کربید سیلیکون شامل ضرایب کشسانی، مدول حجمی، یانگ و برشی و ضریب پواسون در دما و فشار محیط و فشار و دمای بالا به ترتیب تا 50 گیگاپاسگال و 1000 کلوین با استفاده از پتانسیل محاسبه شده که نشان از هم خوانی بسیار خوبی با مقادیر تجربی دارند. خواص ترمودینامیکی کربید سیلیکون از قبیل دمای ذوب، دمای دیبای، ظرفیت گرمایی ویژه در حجم و فشار ثابت، ضریب انبساط خطی، و ضریب رسانش گرمایی در فشار محیط و فشار بالا نیز با استفاده از دینامیک مولکولی و نظریهٔ تابعی چگالی محاسبه شدند.

کلیدواژگان: کربید سیلیکون، دینامیک مولکولی، نظریهٔ تابعی چگالی، دما و فشار بالا، خواص مکانیکی و ترمودینامیکی

مقدمه

کربید سیلیکون بهطور اتفاقی در سال **1890** توسط ادوارد آکسون¹ یکی از دستیاران توماس ادیسون کشف شد. این کشف زمانی اتفاق افتاد که او در حال آزمایشهایی بر روی سنتز الماس بود. وی ابتدا بر این

تصور بود که مادهٔ جدید ترکیبی از کربن و آلومینیوم موجود در خاک رس است و این تصور موجب شد تا آکسون مادهٔ جدید را کربورندوم² نامگذاری کند. امروزه کربید سیلیکون بهروشهای مختلفی ساخته میشود که متداولترین آن واکنش حالتجامد بین

* نويسنده مسئول: g_alahyarizadeh@yahoo.com

باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است. ۲۲ (۲۰) این مقاله تحت مجوز کرینیو کامنز تخصیص 4.0 بینالمللی میباشد.

¹Edward G. Acheson ²carborundum

رانش اشباع بههمراه فاصلهٔ زیاد پیوندها و ضریب هدایت گرمایی فوقالعادهٔ آن باعث شده است تا عملکرد و کارایی آن در سیستمهایی که در دما، فشار و بسامد بالا کار میکنند بیشتر به چشم آید. کربید سیلیکون همچنین توانسته است در صنایع الکترونیکی و اپتیکی جایگاه محکمی برای خود ایجاد کند [8-4]. علت این خواص انرژیهای پیوند⁴ بالای سیلیکون و كربن بهطور مجزا است كه تركيب آنها نيمرسانايي مستحکم و بیعیب و نقص میسازد. این ترکیب گزینه بسیار مناسبی برای سیستمهایی است که در شرایط دما و فشاری سخت کار میکنند. کربید سیلیکون هم بهعنوان ماده اصلي و هم بهعنوان ماده پوششي⁵ در صنعت استفاده می شود. مقاومت در برابر تشعشع یکی دیگر از ویژگی هایی است که توجهات به این نیمه رسانا را در صنعتهای هستهای و هو افضا به خود جلب کرده است [9].

در دهههای اخیر مطالعات فراوانی بر روی انواع ساختارها، خواص مکانیکی و ترمودینامیکی کربید سیلیکون، بهصورت نظری و عملی انجامشده است [17-17و ۵،٦،٥]. اما تاکنون هیچ گونه مطالعهٔ جامعی بر روی تمام خواص ساختار 3C کربید سیلیکون در دما و فشارهای بالا که بهطور کامل با مقادیر تجربی مقایسه شده باشند، انجام نگرفته است.

بهدست آوردن خواص مکانیکی و ترمودینامیکی کربید سیلیکون و نیز رفتار آن در فشار و دمای بالا، نیازمند

ماسهٔ سیلیسی و کک نفتی (کربن) در دمای بالای کوره همراه با قوس الكتريكي است [1]. كربيد سيليكون يك نيمرسانا با پيوند كووالانسى است. در ساختمان بلورين، هر اتم سيليكون با چهار اتم كربن پیوند برقرار میکند. ساختارهای فراوانی از کربید سیلیکون وجود دارد که چندگونه¹ نیز نامیده می شوند [2]. ساختارهاي مختلف بلورين كربيد سيليكون معمولاً بهصورتهای مکعبی، ششوجهی و رامبوهدرال² وجود دارند. از اینرو برای نام گذاری انواع آنها از حرف اول این ساختارهای بلورین استفاده میشود. برای مثال انواع کربید سیلیکونهای مکعبی بهنوع "C" و انواع ششوجهیها بهنوع "H" معروف شدهاند. این ساختارها از توالیهای مختلف لایههای سیلیکون و کربن بر روی یکدیگر ایجاد می شوند [1]. با اینکه تاكنون بیش از 240 نوع از ساختارهای مختلف برای كربيد سيليكون شناسايي شده است اما مهمترين أنها که در صنعت کاربرد دارند سه ساختار 4H و 4H و می،باشند. ساختار اولی بهشکل مکعبی و دو ساختار دیگر بهصورت ششوجهی هستند. گفتنی است که ساختار 3 به (eta) یا زینک بلند 8 و ساختار 6H به آلفا (α) نيز معروف مي باشند [3].

ساختارهای مختلف کربید سیلیکون بهخاطر خواص فوقالعاده مکانیکی، فیزیکی، ترمودینامیکی و شیمیایی، یک سرامیک بسیار جذاب برای اکثر صنایع است [34]. تحرک بالای الکترونهای کربید سیلیکون، سرعت

⁴ Bonding Energy ⁵ Coating ¹Polytype

² rombohedral

³ zinc-blende

آزمایشهای متعددی است. این آزمایشها علاوه بر صرف زمان زیاد، بسیار پرهزینه نیز میباشند. ازاین رو همان گونه که در سرتاسر جهان از روش های شبیه سازی کامپیوتری متعددی همچون دینامیک مولکولی کلاسیکی و کوانتومی برای به دست آوردن خواص مواد در شرایط مختلف استفاده می شود، در این پژوهش نیز با استفاده از شبیه سازی های مولکولی در قالب روش های دینامیک مولکولی¹ و نظریهٔ تابعی چگالی² مبتنی بر تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) به بررسی خواص مکانیکی و ترمودینامیکی ساختار 3C کربید سیلیکون در دما و فشارهای بالا پرداخته شده است. با اطلاعات نظری موجود و به دست آمده از شرایط آزمایشگاهی مقایسه شده است.

روش محاسبات

در این پژوهش از روش کوآنتومی مبتنی بر نظریهٔ تابعی چگالی و روش کلاسیک بر پایهٔ دینامیک مولکولی برای شبیهسازی استفاده شده است. شبیهسازی دینامیک مولکولی با استفاده از کد لمپس³ و شبیهسازی نظریهٔ تابعی چگالی بهوسیلهٔ کد کستپ⁴ انجام گرفته است. برای اعمال هرگونه عملیات شبیهسازی در دینامیک مولکولی، به یک پتانسیل بین اتمی برای برقراری نیروی بین اتمها نیاز است.

سیلیکون و کربن، پتانسیل،های تروسوف [18] و واشیشتا [8] میباشند. در این پژوهش از پتانسیل واشیشتا و تروسوف برای بهینه کردن ساختارها و محاسبة خواص مورد نظر استفاده شده است. برای بالا بردن دقت محاسبات، ساختار مکعبی کربید سیلیکون در راستاهای مختلف تکرار شده و یک ابریاخته⁵ ایجاد می گردد. اندازهٔ ابر یاخته به پارامترهای مورد نظر برای محاسبه بستگی دارد. بهعنوان نمونه، برای محاسبهٔ خواص عمومی ماده از قبیل خواص ساختاری مانند ثوابت شبکه و همچنین خواص مکانیکی، ابر یاختهای با ابعاد (4×4×4) و تعداد اتمهای 4096 كفايت ميكند. با اين حال، براي محاسبة برخي خواص دیگر مانند ضریب رسانش گرمایی نیاز به ابر یاختهای با ابعاد به مراتب بزرگتر است. شکل 1 ساختار تكرار شده كربيد سيليكون مكعبي در محيط كد لميس را نشان میدهد. این شکل بهکمک رابط گرافیکی

معروفترين پتانسيلهاي بين اتمي مورد استفاده براي

VMD⁶ بهنمایش درآمده است. از این ساختار تکرار شده برای ادامه محاسبات دینامیک مولکولی استفاده شده است.

⁵ Super cell

⁶Visual Molecular Dynamics

¹ Molecular dynamics (MD)

²Density functional theory(DFT)

³ Lampps

⁴CASTEP

$$\begin{pmatrix} \sigma_{1} \\ \sigma_{2} \\ \sigma_{3} \\ \sigma_{4} \\ \sigma_{5} \\ \sigma_{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & \dots & C_{16} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{61} & \dots & C_{66} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \varepsilon_{1} \\ \varepsilon_{2} \\ \varepsilon_{3} \\ \varepsilon_{4} \\ \varepsilon_{5} \\ \sigma_{6} \end{pmatrix}$$
 1

مهمترین خواص کشسانی برای ساختارهای مکعبی C11، C12، C12 هستند، که دیگر خواص مکانیکی ساختار ازجمله مدول های یانگ، حجمی، برشی، ضریب پوسان و ضریب انعطاف پذیری نیز به وسیله این ضرایب همانند معادلات 2 تا 4 محاسبه می شوند [11،19].

$$B = \frac{1}{3}(C_{11} + 2C_{12})$$
 2

$$G = \frac{1}{5} (C_{11} - C_{12} + 3C_{44})$$
 3

$$v = \frac{B - \frac{2}{3}G}{2(B + \frac{1}{3}G)}, Y = \frac{9B}{1 + \frac{3B}{G}}$$
 4

در این پژوهش از دینامیک مولکولی برای محاسبهٔ دمای ذوب ساختارهای کربید سیلیکون مورد نظر نیز استفاده شده است. علت این اتفاق همخوانی خوب نتایج حاصل شده با نتایج تجربی و نیز پژوهش های معتبر انجام گرفته در این زمینه است [8،۳۳]. برای محاسبهٔ نقطهٔ ذوب از پتانسیل واشیشتا استفاده شده است. پتانسیل واشیشتا توانایی بسیار خوبی در محاسبهٔ برخی از خواص ترمودینامیکی دارد [8]. روش های گوناگونی برای محاسبهٔ دمای ذوب وجود دارد. از روش های





شكل1. الف: یاختهٔ اولیه بلور ساختار 3C كربید سیلیكون، ب: ابریاخته تكرار شده از ساختار مكعبى كربید سیلیكون.

برای بهدست آوردن خواص کشسانی در دینامیک مولکولی، ساختارهای بهینه شده تحت نیروهای معکوس شوندهٔ کششی و فشاری با یکمیزان پایین از کرنش قرار داده میشوند. در این پژوهش ساختارهای موردنظر از کربید سیلیکون تحت تأثیر کرنشی بهاندازه 10/00 نانومتر بهازای هر فمتوثانیه قرار میگیرند. نیروهای ایجادکننده کرنش سه مرتبه معکوس شده تا سیستم هم تحت تأثیر نیروهای فشاری و هم تحت تأثیر نیروهای کششی قرار بگیرد. تانسور تنش مربوط بهاین کرنش ها محاسبهشده و با توجه بهاین تنش و کرنشها، ماتریس خواص کشسانی محاسبه می گردد.

ايمان پيوسته و همكاران	ر ترمودينايكي	محاسبهٔ خواص مکانیکی و	26
$H(\mathbf{P}, \mathbf{V}) = \mathbf{E}(\mathbf{V}) + \mathbf{V}\mathbf{P}(\mathbf{V})$	5	ن زمینه می توان بهروش ساندویچ ¹ ، روش	معروف در ایر
E(V) نشاندهنده انرژی کل سیستم است قریب GGA محاسبه میگردد. V حجم P(V نشان دهندهٔ فشار سیستم در حجم ست. برای اینکه آنتالپی سیستم در دمایی ر محاسبه شود از تقریب مدل شبههماهنگ ده میشود که مفهوم اساسی آن جایگزینی حالت ⁴ با مربع بسامد تابع موج است. لذا بق با مرجع شمارهٔ15 بهشکل زیر اصلاح	در رابطهٔ بالا که توسط ت سیستم و (مورد نظر ام بالاتر از صفر دیبای ³ استفا تابع چگالی معادلهٔ5 مطا	² و روش هنگرد اشاره کرد. هر سهٔ این ر تقریبی شبیه به یکدیگر هستند [20]. در ز روش هنگرد برای محاسبهٔ نقطهٔ ذوب است. روش کار بدینصورت است که است. روش کار بدینصورت است که است. روش کار بدینصورت است که است. مها در دمای نزدیک به دمای محیط از اتمها در دمای نزدیک به دمای محیط بار استفاده می شوند. برای این کار از یک بار استفاده می شود. پس از تعادل رسانی، باده از یک هنگرد دیگر دما-فشار به دمای برده می شود و مجدد به تعادل می رسد.	سطوح متحرک روشها بهطو، این پژوهش ا استفاده شده سیستم متشکل بهتعادل رساند هنگرد دما-فش سیستم با استف اندکی بالاتر ب
$G^*(\mathbf{V};\mathbf{P},\mathbf{T}) = \mathbf{E}(\mathbf{V}) + \mathbf{V}\mathbf{P}(\mathbf{V}) + \mathbf{A}_{vib}(\boldsymbol{\theta}(\mathbf{V}))$	مىشود: (/,T) (/	هنگرد دیگر دما-فشار، دما را بهاندازهٔ و میزان انرژی کل سیستم بهازای هراتم تاسبه میشود. هرگونه جهش در انرژی	سپس با یک زیادی بالابرده در هر دما مح
ل در سمت راست انرژی کل سیستم و	كه جملهٔ او	هٔ تغییر فاز در شبکه است. برای محاسبهٔ	كل، نشاندهند
نرات ارتعاشات شبکه در امرژی کل است ، معادلات زیر بیان میشود [15]:	جمله دوم ات که بهصورت	اختار 3C کربید سیلیکون از تعداد 4096 ده است. شرایط مرزی نیز بهصورت	دمای ذوب س اتم استفادهشا
$A_{vib}(\theta(\mathbf{V}), \mathbf{T}) = nk_B T \times \left[\frac{9}{8}\frac{\theta(\mathbf{V})}{\mathbf{T}} + 3\ln(1 - e^{-\theta(\mathbf{V})/T}) - D(\frac{\theta(\mathbf{V})}{T})\right]$ $D(\mathbf{y}) = \frac{3}{y^3} \int_0^y \frac{x^3}{e^x - 1}$ $y = \frac{\theta(\mathbf{V})}{T}$	7	س شده است. ظرفیت گرمایی ویژه از روش نظریهٔ تابعی مشده است که علت آن عدم توانایی روش کولی در ارائه پاسخ مناسب است، نتایج حاصل با پتانسیل واشیشتا دارای	دورهای مفروظ برای محاسبهٔ « چگالی استفاده دینامیک مول بهگونهای که
7, θ(V) دمای دیبای است که تابعی از	در معادلات	خطا و با پتانسیل ترسوف دارای 200	100 درصد ·
ىد و بەصورت معادلات شمارة8 محاسبە	حجم مىباش	باشند.	درصد خطا مے

آنتالپی در دمای 0 کلوین بهصورت زیر نوشته می شود: می شود [15].

¹Sandwich method

³ Quasiharmonic Debye model ⁴ Density of state(DOS)

² moving interface method

$$\theta(\mathbf{V}) = \frac{h}{k_{B}} \left[6\pi^{2} \mathbf{V}^{-5} n \right]^{\frac{1}{3}} f(\sigma) \sqrt{\frac{B_{s}}{M}}$$
$$f(\sigma) = \left\{ 3 \left[2 \left(\frac{2(1+\sigma)}{3(1-2\sigma)} \right)^{\frac{3}{2}} + \left(\frac{(1+\sigma)}{3(1-\sigma)} \right)^{\frac{3}{2}} \right]^{-1} \right\}^{\frac{1}{3}}$$
8

$$B_{T}(p,T) = [V(\frac{\partial^{2}G^{*}(V;p,T)}{\partial V^{2}})_{p,T}V_{eq}(p,T)$$

$$B_{s} = B_{T}(1+eqT)$$

$$\gamma = -\frac{d\ln(\theta(V))}{d\ln(V)}$$
9

در معادلات9، α ضریب انبساط خطی و γ پارامتر گرونیسن⁵است.

$$C_{v} = \frac{12}{5} \pi^{4} N k_{B} (T / \theta(D))^{3}$$
 10

در معادله 10 نیز دمای دیبای است [15].
$$heta(\mathrm{D})$$

ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت از معادلهٔ11 بهدست می آید [21].

$$C_{P}(\mathbf{T}) = C_{V}(\mathbf{T}) + 9 \mathbf{T} \mathbf{V} \mathbf{B}(\mathbf{T}) \alpha^{2}(\mathbf{T})$$
 11

$$\alpha_{lin} = \frac{1}{3} \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{\gamma C_V (T)}{3B V_0}$$

$$\gamma = -\frac{d \ln(\theta(V))}{d \ln(V)}$$

12

در معادلهٔ12، γ پارامتر گرونیسن ،Cv گرمای ویژه در حجم ثابت، B مدول حجمی و V حجم سلول واحد ساختار مورد نظر است.

پارامتر پایانی محاسبه شده در این پژوهش ضریب رسانش گرمایی است. ضریب رسانش گرمایی به عنوان نسبت شار گرمایی، به شیب تغییرات دما نسبت به طول تعریف می شود. در این پژوهش برای بررسی این پارامتر ترمودینامیکی از روش های مبتنی بر دینامیک مولکولی و پتانسیل واشیشتا استفاده شده است. روش های متفاوتی برای محاسبهٔ ضریب رسانش گرمایی با استفاده از دینامیک مولکولی وجود دارد که از معتبرترین آن ها می توان به روش غیر تعادلی دینامیک

مربوطه بهصورت دورهای انتخاب شده است. ضریب رسانش گرمایی از قانون فوریه بهصورت زیر محاسبه می شود [22].

$$K = -\frac{j}{\frac{\Delta T}{\Delta L}A}$$
13

در رابطهٔ 13، لا شار گرمایی، A سطح مقطع عبور شار و $\frac{AT}{AL}$ شیب تغییرات دما به طول تعریف می شود. برای اندازه گیری ضریب رسانش گرمایی ابتدا لازم است شار گرمایی محاسبه شود، در این حالت می بایست جعبه شبیه سازی در راستای مورد نظر به حداقل 20 لایه تقسیم شود که لایهٔ اول دارای کمترین دما و لایهٔ آخر دارای بیشترین دما باشد (چشمه و چاه گرمایی). در هر گام زمانی، دمای لایه های میانی نسبت به دمای لایهٔ اول و آخر جعبه شبیه سازی تغییر کرده و در نهایت به تعادل می رسد. در این حین همچنین میزان شارش گرما نیز در تمام مدت شبیه سازی بر حسب وات محاسبه می شود یا خته های واحد به صورت 100×4×4 در نظر گرفته شده است. به علت اینکه قرار است ضریب رسانش گرمایی در راستای z محاسبه شود، بنابراین باید تکرار یا خته ها

را در این راستا افزایش داده تا فرایند بهتعادل رسیدن دمایی بهتر صورت پذیرد. هر گام زمانی نیز برای بهتعادل رسانی آفمتوثانیه و تمام مدت شبیهسازی برای سیستم 20 ثانیه در نظر گرفتهشده است. همچنین از شرایط مرزی دورهای در تمام جهتها برای شبیهسازی استفادهشده است.

نتايج

همان گونه که بیان گردید برای بهینه کردن ساختار از پتانسیلهای ترسوف [18] و واشیشتا [8] استفاده شده است. در جدول1 می توان دقت این بهینه سازی را با نتایج آزمایشگاهی یا دیگر پژوه شهای انجام گرفته در این زمینه مقایسه کرد. از مقایسهٔ نتایج بهینه سازی، این نتیجه حاصل می شود که هر دو پتانسیل قابلیت بالایی در بهینه سازی ساختارهای مورد نظر دارند. بهینه ترین حالت انرژی و ثابت شبکه در هر دو پتانسیل، مقادیری کاملاً نزدیک به یکدیگر هستند، پس هر دو پتانسیل قابلیت تقریباً یکسانی در به دست آوردن ثابت شبکه و انرژی هم بستگی دارند با این تفاوت که پتانسیل ترسوف محاسبات مربوطه را در زمان کمتری انجام می دهد.

ساختار	پتانسیل	ثابت شبکه a (Å)	انرژی همبستگی (eV/atom)	چگالی (gr/cm³)	حجم ياخته واحد (Å ³)
3C	ترسوف	4/36	-6/34	3/2148	82,84
	واشيشتا	4,36	-6/34	3 _/ 2147	82,77
	تجربى	4,36ª	-6/34ª	3/217ª	82/88 ^c

جدول1. مقادیر بهینهسازی شده برای کربید سیلیکون با استفاده از پتانسیلهای ترسوف و واشیشتا و مقایسه با نتایج تجربی.

°[13] ^a[8]

شدهاند، آورده شده و با مقادیر تجربی مقایسه شده است. همخوانی بسیار خوب نتایج محاسبه شده با مقادیر تجربی بیانگر دقت خوب روش دینامیک مولکولی و پتانسیل ترسوف است. با توجه به نتایج جدول2، ساختار 3C کربید سیلیکون مدول حجمی، یانگ و برشی بسیار بالایی را ارائه می دهند که این خود بیانگر سختی بسیار بالای کربید سیلیکون است. از این ساختارهای بهینهشده در فشار و دماهای بالا برای بهدست آوردن خواص مکانیکی استفاده شده است. استحکام هر ماده، یک خاصیت کلیدی از آن ماده است که رفتار آن ماده تحت تأثیر نیروهای خارجی را توصیف میکند. پاسخی که ساختار هر ماده به نیروهای خارجی میدهد به عنوان خواص کشسانی شناخته میشود. در جدول2 خواص مکانیکی کربید سیلیکون در دما و فشار محیط که با پتانسیل ترسوف محاسبه

جدول2. خواص مکانیکی کربید سیلیکون در دما و فشار محیط محاسبه شده توسط دینامیک مولکولی و پتانسیل ترسوف به همراه نتایج تجربی.

	C ₁₁ (GPa)	C12 (GPa)	C44(GPa)	مدول حجمی (GPa)	مدول برشی (CPa)	مدول یانگ (CPa)	ضريب
· .	277.05	1/1 25	226.02	(GF u)	100	200.02	پوسان
ىرسوف	377 ₁ 03	141/23	230/03	221/14	109	300/72	U/Z I
تجربى	390 ^b	142 ^b	150-256 ^b	225 ^ь	124 ^b	314 ^g	0 _/ 267 ^ь
					192 ^d	649 ^g -469 ^h	
$^{g}E = 3$	$B(1-2\upsilon)$	^b [8]	^h [17]	^d [24]			1

بهمنظور بررسی صحت محاسبهٔ خواص مکانیکی در فشار بالا، مدول حجمی ساختار 3C کربید سیلیکون در بعضی از فشارها محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه شده است. جدول شمارهٔ 8 بیانگر مدول حجمی ساختار 3C کربید سیلیکون محاسبه شده توسط دینامیک مولکولی

است که در برخی از فشارها محاسبه و با مقادیر تجربی [13] مقایسه شده است. از مقایسهٔ نتایج جدول3 میتوان بهدقت بالای روش دینامیک مولکولی در ارائه نتایج مناسب در فشارهای بالا پیبرد.

فشار	ثابت شبکه	مدول حجمى	مدول حجمی دینامیک
(GPa)	(A)	تجربی(GPa)	مولكولى(GPa)
0,2	4/36	225(±5) ^a	221
2 _/ 2	4,35	232(±16) ^a	222
6,65	4,32	235(±13) ^a	237
16 _/ 50	4,26	264(±12) ^a	256
26 _/ 7	4/22	304(±16) ^a	296
35,5	4,18	355(±19) ^a	340
45 _/ 5	4,14	370(±13) ^a	369

جدول3. مقایسه مدول حجمی محاسبهشده توسط دینامیک مولکولی با مقادیر تجربی در فشار بالا.

^a[13]



شکل2. تغییرات مدول کشسانی کربید سیلیکون 3C نسبت به فشار.

تغییرات ضریب کشسانی ساختار 3C کربید سیلیکون نسبت به دما در شکل 3 ترسیمشده است. برای مقایسه این نتایج با نتایج تجربی، شیب تغییرات خطی مدول کشسانی با شیب تغییرات مدول کشسانی منبع تجربی [25] موجود در جدول4 مقایسه شده است. از مقایسه انجامشده در جدول شماره4، می توان به هم خوانی نسبتا خوب نتایج دینامیک مولکولی با نتایج تجربی پی برد. در شکل2 روند تغییرات ثوابت کشسانی ساختار 3C کربید سیلیکون رسم شده است. ثوابت کشسانی بهصورت تقریباً خطی با فشار افزایش می یابند. در این میان با اینکه C44 شیب کمتری نسبت دیگر ثوابت کشسانی دارد، اما همچنان شیب صعودی دارد، گفتنی است زمانی که در اثر اعمال فشار C44 شیب نزولی پیدا می کند، ساختار مورد نظر با توجه به معیار بورن [5] در جهت ناپایداری مکانیکی و متالشی شدن پیش می رود.

میزان اختلاف اندک نیز تغییر زیادی در نتایج ایجاد

نمى كند.



شکل3. تغییرات مدول کشسانی کربید سیلیکون3C نسبت به دما. **جدول4.** مقایسه شیب تغییرات مدول کشسانی کربید سیلیکون3C در دینامیک مولکولی با نتایج تجربی.

	شیب دینامیک مولکولی	شيب تجربي
C ₁₁	-0,032	-0/025
C ₁₂	-0,0013	-0/007
C ₄₄	-0,019	-0,011

در شکل 4 مدول حجمی، برای کربید سیلیکون 3C در فشار و دمای بالا بهترتیب تا 50 گیگاپاسگال و 1000 کلوین محاسبه شده است. با افزایش فشار مدول حجمی کربید سیلیکون افزایش مییابد اما با افزایش دما، مدول حجمی بهصورت خطی کاهش مییابد. از شکل 3 این گونه میتوان نتیجه گیری کرد که تغییرات خواص مکانیکی کربید سیلیکون در دما و فشارهای بالا از یک روند خطی پیروی میکند.



شکل4. تغییرات مدول حجمی کربید سیلیکون C بهصورت تابعی از فشار و دما.

شکل 5 نحوه تغییرات انرژی کل سیستم متشکل از ساختار 3C کربید سیلیکون را در فشار محیط و بهصورت تابعی از دما نشان میدهد. در دمای 3250 کلوین سیستم دچار یک جهش در انرژی شبکه و تغییر فاز میشود، این دما همان دمای نقطهٔ ذوب است. دمای ذوب تجربی کربید سیلیکون 40±310 کلوین گزارش شده است [8] که نشان میدهد دمای ذوب محاسبه شده در این پژوهش هم خوانی خوبی با نتایج تجربی دارد. شکل 6 نقطهٔ ذوب ساختار 3C کربید سیلیکون را به صورت تابعی از فشار نشان می دهد. همان گونه که از شکل پیداست با افزایش فشار دمای ذوب



شکل5. تغییرات انرژی کل سیستم متشکل از ساختار 3C کربید سیلیکون بهصورت تابعی از دما در فشار محیط.



شکل6. دمای ذوب کربید سیلیکون به صورت تابعی از فشار.

دمای دیبای برای ساختار 3C کربید سیلیکون در فشار محیط برحسب روابط ذکر شده محاسبه و در شکل 6 ترسیم شده و همچنین با مقادیر تجربی موجود [26] مقایسه شده است.



شکل7. دمای دیبای برای کربید سیلیکون 3C بهصورت تابعی از دما در فشار محیط.

همانطور که از شکل7 پیداست، نتایج محاسبه شده برای دمای دیبای از دقت خوبی برخوردار است.

در نهایت ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت (Cv) با استفاده دمای دیبای و معادلهٔ10 محاسبه شده است. در شکل 8 ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت برای ساختار 3C کربید سیلیکون به صورت تابعی از دما و نیز به همراه مقادیر تجربی [14] نشان داده شده است. در بازهٔ دمایی 0 تا 500 کلوین با افزایش دما ظرفیت گرمایی متناسب با مکعب دما افزایش مییابد تا درنهایت در دماهای بالا به یک مقدار ثابت (47 ژول بر مل -کلوین) میل میکند. همان طور که پیداست نتایج محاسبه شده هم خوانی بسیار خوبی با نتایج تجربی دارد.



شکل8.ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت (Cv) بهصورت تابعی از دما و مقایسه آن با نتایج تجربی.

نتایج بهدست آمده به طور کامل بیانگر صحت روش نظریهٔ تابعی چگالی و تقریب شبه هماهنگ در محاسبه ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت است. در شکل 9 نیز تغییرات ظرفیت گرمایی ویژه به صورت تابعی از فشار و دما نمایش داده شده است. شکل 9 همچنین بیانگر این است که افزایش فشار تأثیری قابل توجهی بر ظرفیت گرمای ویژه در حجم ثابت ندارد.



شکل9. ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت (Cv) بهصورت تابعی از دما و فشار

در شکل 10 ضریب انبساط خطی ساختار 3C کربید سیلیکون را بهصورت تابعی از دما بههمراه مقادیر محاسبه شدهٔ تجربی [27] نشان می دهد. همان طور که از شکل 9 پیداست میزان محاسبه شده برای ضریب انبساط خطی دارای اختلاف قابل قبولی با مقادیر تجربی است. علاوه بر این مقدار ضریب انبساط خطی محاسبه شده برای ساختار 3C کربید سیلیکون در این پژوهش برتری چشم گیری در هم خوانی با مقادیر تجربی نسبت به دیگر پژوهش معتبر انجام شده [28] در این زمینه دارد. دلیل افزایش اختلاف میان مقادیر محاسبه شده و مقادیر تجربی در دمای بالا ناشی از اثرات غیر هماهنگی است که در دمای بالا ایجاد شده و سیستم قادر به وفق دادن خود با این تغییرات نیست [21].



شکل10. ضریب انبساط خطی محاسبهشده بهصورت تابعی از دما و مقایسه با مقادیر تجربی.

شکل 11 ضریب انبساط خطی ساختار 3C کربید سیلیکون را در دما و فشارهای مختلف تا 50 گیگاپاسگال نشان میدهد. همان طور که انتظار می رود با افزایش فشار، ضریب انبساط خطی کاهش می یابد. همچنین در فشارهای بالا اثرات غیر هماهنگی کاهش

مییابد که باعث افزایش دقت در محاسبه ضریب انبساط خطی میشود [29].



شکل11. ضریب انبساط خطی به صورت تابعی از فشار و دما.

همانطور که از معادلهٔ11 پیداست، بهعلت پایین بودن ضريب انبساط خطى در كربيد سيليكون مقدار اختلاف بین ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت و ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت در دماهای زیر 1000 كلوين قابل چشم پوشي است [21،29]. در دماي 300 كلوين، قسمت دوم معادلة 11 (اختلاف بين Cp و CV) برابر با مقدار 5-10×4/5 ژول برمل-کلوین است و در دمای 1000 کلوین نیز این مقدار به 5-10×2/5 می رسد. این مقادیر نسبت به مقادیر Cp و CV (عددی در بازهٔ 20 تا 50 ژول بر مل-كلوين) قابل چشم پوشي است. از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر محاسبهٔ ضریب رسانش گرمایی، تعداد اتمهای موجود در جعبه شبیهسازی است. با افزایش تعداد اتمها این پارامتر افزایشیافته تا به یک حد خاص رسیده و ازآنجا به بعد ثابت میماند و یا مقدار بسیار کمی افزایش خواهد داشت، بنابراین در اولین گام می بایست از بابت تعداد کافی اتمهای موجود در جعبه شبیه سازی اطمینان حاصل شود، لذا تعداد اتمها را افزایش داده و ضریب رسانش گرمایی

محاسبه می شود. اگر با افزایش اتمها این پارامتر به طور تقریبی ثابت بماند، تعداد اتمهای در نظر گرفته شده، مناسب برای شبیه سازی دینامیک مولکولی است. شکل 12 ضریب رسانش گرمایی را برای ساختار 3C کربید سیلیکون در دمای 300 کلوین و فشار محیط، به ازای تعداد اتمهای گوناگون نشان می دهد. همان طور که از شکل پیداست، افزایش تعداد اتمها تأثیر بسیار اندکی در ضریب رسانش گرمایی دارد که این بیانگر آن است که تعداد اتمهای موجود در جعبه شبیه سازی به حد کافی رسیده است [30].



شکل12. ضریب رسانش گرمایی کربید سیلیکون بهصورت تابعی از تعداد اتمهای موجود در جعبه شبیهسازی.

شکل13 روند تغییرات رسانش گرمایی محاسبه شده توسط دینامیک مولکولی را به صورت تابعی از دما نمایش می دهد. نتایج به دست آمده با مقادیر تجربی [31] مقایسه شده است.



شکل13. تغییرات رسانش گرمایی کربید سیلیکون بهصورت تابعی از دما در دینامیک مولکولی و مقایسه با تجربی.

با افزایش دما اختلاف میان مقدار ضریب رسانش گرمایی محاسبهشده و مقادیر تجربی زیاد می شود. علت این اتفاق به ذات خطی بودن تغییرات ضریب رسانش گرمایی در دینامیک مولکولی برمی گردد، زیرا الكترونها كه عامل اصلى انتقال انرژى محسوب می شوند اثری در محاسبات دینامیک مولکولی ندارند. لذا اگرچه مقادیر محاسبهشده با مقادیر تجربی تفاوتهایی دارد، اما نتایج حاصله کاملاً منطبق با دیگر پژوهشهای انجامگرفته درزمینه دینامیک مولکولی است [30،32]. در شکل14 تغییرات ضریب رسانش گرمایی بهصورت تابعی از دما و فشار برای ساختار 3C کربید سیلیکون رسم شده است. همان طور که از شکل مشخص است. با افزایش فشار ضریب رسانش به میزان بسیار کمی به صورت خطی افزایش می یابد که علت این اتفاق نزدیک شدن اتمها بههمدیگر و تسهیل در انتقال انرژی بین آنهاست.



شکل14. تغییرات ضریب رسانش گرمایی کربید سیلیکون بهصورت تابعی از دما و فشار.

نتيجه گيري

در این تحقیق با استفاده از دو روش شبیهسازی مولکولی کلاسیک و کوانتومی در قالب روشهای دینامیک مولکولی و نظریهٔ تابعی چگالی مبتنی بر تقريب شيب تعميم يافته، خواص مكانيكي و ترمودینامیکی ساختار 3C کربید سیلیکون در دما و فشارهای بالا محاسبه و جهت صحت با نتایج تجربی موجود مقايسه شد. محاسبات ديناميک مولکولي اوليه برای بهینهسازی ساختار کربید سیلیکون با استفاده از دو پتانسیلهای بین اتمی شناخته شده ترسوف و واشيشتا صورت گرفت که نشان از قابليت بالايي هر دو پتانسیل در بهینهسازی ساختارهای مورد نظر داشتند. مشخصات مكانيكي كربيد سيليكون شامل ضرائب کشسانی، مدول حجمی، یانگ و برشی و ضریب پواسون در دما و فشار محیط و فشار و دمای بالا بەترتىب تا 50 گىگاپاسگال و 1000 كلوين با استفادە از پتانسیل ترسوف محاسبه شده که همخوانی بسیار خوبی با مقادیر تجربی از خود نشان دادند. خواص ترمودینامیکی کربید سیلیکون از قبیل دمای ذوب، دمای ديباي، ظرفيت گرمايي ويژه در حجم و فشار ثابت،

[7] M. Nuruzzaman, et al. Structural, elastic and electronic properties of 2H-and 4H-SiC *journal of Engineering Research and Applications* **5** 4 (2015) 48-52.

[8] P. Vashishta, et al. Interaction potential for silicon carbide: a molecular dynamics study of elastic constants and vibrational density of states for crystalline and amorphous silicon carbide. *Journal of applied physics*, **101** 10 (2007) 103515.

[9] L.L. Snead, et al. Handbook of SiC properties for fuel performance modeling. *Journal of nuclear materials* **37** (2007) p. 329-377.

[10] X. Luo, S. Goel, R.L. Reuben, A quantitative assessment of nanometric machinability of major polytypes of single crystal silicon carbide. *Journal of the European Ceramic Society*, **32** 12 (2012) 3423-3434.

[11] E. Konstantinova, M. Bell, V. Anjos, Ab initio calculations of some electronic and elastic properties for SiC polytypes. *Intermetallics*, **16** 8 (2008) 1040-1042.

[12] M. Yoshida, et al., Pressure-induced phase transition in SiC. *Physical Review B*, **48** 14 (1993) 10587.

[13] K. Zhuravlev, et al., Vibrational, elastic, and structural properties of cubic silicon carbide under pressure up to 75 GPa: Implication for a primary pressure scale. *Journal of Applied Physics*, **113** 11 (2013) 113503.

[14] C. Varadachari, R. Bhowmick, Ab initio derivation of a dataset of real temperature thermodynamic properties: Case study with SiC. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, **17** 7 (2009) 075006. ضریب انبساط خطی، و ضریب رسانش گرمایی در فشار محیط و فشار بالا نیز با استفاده از دینامیک مولکولی و نظریهٔ تابعی چگالی محاسبه شدند. خواص فوق العاده کربید سیلیکون در دمای محیط اعم از خواص مکانیکی شامل مدول حجمی (300/14GPa)، خواص مکانیکی شامل مدول حجمی (300/2GPa)، یانگ (300/92GPa) و برشی (189GPa) و ضریب پواسون (0/27) و خواص ترمودینامیکی شامل دمای نوب 3025 کلوین، گرمای ویژه 3/mol.K و ضریب انبساط خطی 1/K ¹⁰⁶ 2/⁵ نشان از پتانسیل ضریب انباط خطی محلف در صنایع مختلف بهخصوص کاربردهای هستهای و فضایی دارد.

مرجعها

[1] A. Rashed, *Properties and Characteristics of Silicon Carbide*. POCO Graphite, Inc. (2002).

[2] J. Fan, P.K. Chu, *Silicon carbide nanostructures: fabrication, structure, and properties.* Springer, New York, (2014)

[3] M. Margaret, *SILICON CARBIDE ALLOYS*, Department of Metallurgy and Engineering Materials., University of Newcastle upon Tyne (1983) 302.

[4] Q. Fan, et al. The Mechanical and Electronic Properties of Carbon-Rich Silicon Carbide. *Materials*, **9** 5 (2016) 333.

[5] X. Dong, Y.C. Shin, Multiscale Modeling for Predicting the Mechanical Properties of Silicon Carbide Ceramics. *Journal of the American Ceramic Society*, **99** 3 (2016) 1006-1014.

[6] Y. Gao, F.C. Zhang, W.H. Zhang. The electronic and structural properties of 3C-SiC: A first-principles study. *dvanced Materials Research.* **72** 7 (2014) 208-212.

[23] ن. رزم آرا، ا. تصدیقی، شبی*ه سازی دینامیک* مولکولی در lammps. موسسه دیباگران تهران، (1395).

[23] N. Razmara, I. Tasdighi, *Molecular Dynamic simulation with Lammps Open source code*, Dibagaran institute Tehran (2016).

[24] R. Carnahan, Elastic properties of silicon carbide. *Journal of the American Ceramic Society* **51** 4 (1968) 223-224.

[25] Z. Li, R.C. Bradt, The single-crystal elastic constants of cubic (3C) SiC to 1000 C. *Journal of materials science* **22** 7 (1987) 2557-2559.

[26] D.N. Talwar, Probing optical, phonon, thermal and defect properties of 3C–SiC/Si (001). *Diamond and Related Materials* **52** (2015) 1-10.

[27] G.A. Slack, S. Bartram, Thermal expansion of some diamondlike crystals. *Journal of Applied Physics* **46** 1 (1975) 89-98.

[28] Y. Wang, et al., Thermal equation of state of silicon carbide. *Applied Physics Letters* **108** 6 (2016) 061906.

[29] K. Karch, et al., Pressure-dependent properties of SiC polytypes. *Physical Review B* **53** 20 (1996) 13400.

[30] T. Kawamura, et al., Thermal conductivity of SiC calculated by molecular dynamics. *Japanese Journal of Applied Physics* **47** 12R (2008) 8898.

[31] J. Li, L. Porter, S. Yip, Atomistic modeling of finite-temperature properties of crystalline β -SiC: II. Thermal conductivity and effects of point defects. *Journal of Nuclear Materials* **255** 13 (1998) 139-152.

[15] B. Thakore, et al., Thermodynamic properties of 3C—SiC. *Chinese Physics B*, 22 10 (2013) 106401.

[16] S. Roy, et al., The mechanical properties of polycrystalline 3C-SiC films grown on polysilicon substrates by atmospheric pressure chemical-vapor deposition. *Journal of applied physics* **99** 4 (2006) 044108.

[17] X. Liu, et al., Optical and mechanical properties of C, Si, Ge, and 3C–SiC determined by first-principles theory using Heyd–Scuseria–Ernzerhof functional. *Materials Science in Semiconductor Processing* **16** 6 (2013) 1369-1376.

[18] P. Erhart, K. Albe, Analytical potential for atomistic simulations of silicon, carbon, and silicon carbide. *Physical Review B* **71** 3 (2005) 035211.

[19] B. Mayer, et al., Ab-initio calculation of the elastic constants and thermal expansion coefficients of Laves phases. *Intermetallics* **11** 1 (2003) 23-32.

[20] H. Yang, et al., A molecular dynamics study on melting point and specific heat of Ni 3 Al alloy. Science in China Series G: *Physics Mechanics and Astronomy* **50** 4 (2007) 407-413.

[21] K. Karch, et al., Pressure-dependent dynamical and dielectric properties of cubic SiC. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 8 17 (1996) 2945.

[22] M. Zhang, et al., Thermal conductivities of molecular liquids by reverse nonequilibrium molecular dynamics *.The Journal of Physical Chemistry B* **109** 31 (2005) 15060-15067.

37

همكاران	ايمان پيوسته و	و ترمودينايكي	محاسبة خواص مكانيكي
pressure: Vacuum 15	First-principle 4 (2018) 37-43.	calculations,	[32] J.P. Crocombette, et al., Molecular dynamics modeling of the thermal conductivity of irradiated SiC as a function of cascade overlap. <i>Journal of applied physics</i> 101 2 (2007) 023527.
			[33] H. Shen, MD simulations on the melting and compression of C, SiC and Si nanotubes, <i>Journal of materials science</i> 42 15 (2007) 6382-6387.
			[34] I. peivaste, et al., Comparative study on mechanical properties of three different SiC polytypes(3C, 4H and 6H) under high